

## 主要設備一覧

設備名	メーカー	型 式	台 数	ワークスペース
グラインディングセンター	OKK	GC4	2	800×410×460
		GC5	3	1250×560×510
		G C 7	1	1550×740×660
		V P 600	2	1300×610×460
	DMG MORI	NVX5100	1	1050×530×510
CNC円筒研削盤	シギヤ精機	GP45B・150ND2	1	φ450×1500
		GP55B・150ND2	1	φ550×1500
		GP65C・220ND2	1	φ650×2200
円筒研削盤	豊田工機	GOP32×100	1	φ320×100
CNC円筒研削盤（内研付）	シギヤ精機	GPL40・100	1	φ410×1000
円筒研削盤（内研付）	シギヤ精機	G P -30 B ・ 60H	1	φ300×60
		GP65C・150ND	1	φ650×1500
	豊田工機	GL4P-100S2	1	φ450×1000
	大隈機械	G P -55	1	φ550×1750
		G P -33	1	φ330×1000
内面研削盤	大成機械	GRI-1000N2	1	φ500×500
平面研削盤	KENT	KSG-715ZT	1	1500×700
	岡本工作所	PSG84DX	1	800×400
		PSG64DX	1	600×400
		PSG63DX	5	600×300
		PSG52EN	1	500×200
横軸ロータリー研削盤	東京精機工作所	TSKK T R -60	5	φ600
	三正製作所	G K -8	1	φ800
スライディングマシーン	東京精機工作所	T S K -4020	1	400×200
ワイヤーソー	ヤスナガ	U-400	1	120×150×120
	タカトリ	MWS-327	1	300×270×170
		MWS-610SN	1	260×270×160
両面ラップ盤	スピードファーム	DMS-9B-5L	5	φ200×5枚
	天野	4C	3	φ90×4枚
片面ラップ盤	ミロク製作所	MPS 380-3	2	φ100×3
3次元測定器	ミットヨ	B H - V -504	1	500×400
	東京精密	SVA NEX	1	1500×800
画像測定器	キーエンス	VH-7000	1	250×250
万能精密投影機	ミットヨ	PJ-3000	1	110×90
表面粗さ計	ミットヨ	SJ-201P	1	—
工具顕微鏡	オリンパス	STM（50倍～1000倍）	1	100×50
光学顕微鏡	ニコン	20倍	2	φ50
超音波洗浄機	サン電子	防爆式	1	350×350×300
浄化槽設備	中山理化	6t	1	1式